

Application of Ultrasonic Sensors to Robot Measurement / Seiji AOYAGI Key words: robot, ultrasonic transmitter, ultrasonic receiver, 3-D measurement, electric spark, directivity, micro sensor

1. はじめに

超音波センサは視覚センサ等の他のセンサに比較して処 理時間が短く、小形・軽量であり、安価で手軽に扱えると いう理由から、従来そのロボットへの応用が数多く試みら れてきた.それらは(1)比較的近い壁面の距離と傾きを計 測するもの¹⁾, (2)対象物や障害物の位置と形状の認識, すなわち外界環境認識を行うもの2)~5),(3)外界に基準座 標系をおき、そこでのロボットの絶対的な位置・姿勢を計 測するもの^{6)~8)}に分類される.図1にこれらの分類を模式 的に示す. (1),(2)の研究ではロボットに発信器と受波器 (または送受兼用のセンサ)が取り付けられ、外界からの 反射波の伝播時間、振幅、位相等の情報をもとに外界環境 を認識する.(2)はさらに、無指向性の超音波を用いて音 響映像を得るタイプ(図1のBタイプ)と,指向の鋭い ビーム状の超音波を用い、それを走査したり、複数のセン サを用いたりするタイプ(同Cタイプ)に分類される. 一方(3)の研究ではロボットに発信器を取り付け、外界の 既知の位置に受波器を設置しておき,発信器,受波器間の 超音波の伝播時間の情報をもとに三角測量の原理によりロ ボット自体の位置・姿勢を外部から計測する.

本稿では上記の分類の(3)に属する研究(図1のDタ イプ)として,筆者が研究・開発した超音波センサを用い たロボットの3次元位置・姿勢計測システムを紹介する. また超音波センサを小形化する意義を上記で分類した研究



* 原稿受付 平成7年11月21日
 * 正 会 員 金沢大学工学部(金沢市小立野2-40-20)

1988年東京大学大学院工学系研究科精密機械 工学専攻修士課程修了,1988年金沢大学工学 部機械システム工学科助手,1995年同助教授. 工学博士. ロボット用アクチュエータ,セン サ,特に超音波モータ,超音波センサ,ジャイ ロの研究・開発に従事 のタイプとの関連を踏まえて検討し,超音波センサの小形・マイクロ化に関する最近の研究についても紹介したい.

超音波センサを用いたロボットの位置・ 姿勢計測システム

2.1 開発経緯

ロボットの運動性能を正確に評価することを目的とし て、図2に示すような超音波パルスの伝播時間計測を応用 してロボットの位置・姿勢を計測するシステムを開発し た⁷⁾.本システムの位置計測精度は0.2 mm 程度であり, ロボットの位置繰返し精度の評価の用途には精度不足であ るが,絶対位置決め精度,絶対経路精度等の評価の用途に は対応できる.また本システムは超音波素子が安価,小形 であるため他方式に比べて安価に構成でき,携帯性に優れ ており,メーカ,ユーザが独自に所有できる簡易なロボッ トの運動性能評価システムの候補として有望である.

2.2 3次元位置·姿勢計測原理

図2に示すように4個の受波器を配置し発信器 T(X, Y,Z) と受波器 R_i(x_i , y_i , z_i) との間の超音波パルス伝播 時間の測定値を t_i とする (i=1-4). このとき測定空間内 における音速を C として以下の4式が成立する.

$$(X-x_i)^2 + (Y-y_i)^2 + (Z-z_i)^2 = (Ct_i)^2 \quad (i=1\sim4)$$
(1)

これは変数が X, Y, Z, C である四元連立二次方程式なの で解析的に解くことができる. 姿勢に関しては,図2に示 すように相対位置関係が既知である3個の発信器を用いれ ば,それらの座標を計測することにより求めることができ る.

2.3 超音波発信器および受波器

ロボットは様々な位置・姿勢をとるので,超音波発信器



図1 超音波センサを用いたロボット用計測システムの分類



図2 超音波を用いた3次元位置・姿勢計測原理

は測定精度および指向性の観点から無指向性点音源である ことが望ましい.超音波発信器として従来より圧電バイモ ルフ型,コンデンサ型のものが用いられているが,いずれ も有限の大きさを持つため,その半減角(音圧が発信の正 面方向に対して半分になる角度)は前者が 30° 程度,後者 が 6° 程度であり無指向性近似は不可能である.

そこで図3に示すような電気火花放電を利用した発信器 を開発した.2本の電極針が微少な空隙(ギャップ)を隔 てて対向しており,電板間に衝撃的な高電圧を印加して電 気火花を生じさせると,それに伴い超音波パルスが発生す る.図4に超音波パルスの受信波形を示す.本発信器は機 械振動系を用いていないため波形は超音波パルスが到達し た瞬間をとらえるのに十分な鋭い立上がりを持ち,残留振 動も少ない.またその音圧はロボットの位置・姿勢計測へ



図3 発信器の構造



図4 電気火花による超音波の受信波形

の応用に必要な 2~3 m 程度の距離測定に十分である. 図 5 に本発信器の指向性を実験的に確認した結果を示す. こ れより本発信器はギャップの正面軸に対する角度 θ が ±80°の範囲において音圧,距離測定精度の両面において 無指向性近似できることがわかる.

以上のような特性を生かして,無指向性の発信器が必要 とされる図1のB,Dタイプのシステムへの本発信器の今



ギャップの正面で1m離れた場所での音圧は10 Pa であり、これを基準値として0dBとした. ギャップ中心を中心として発信器を $\pm 90^{\circ}$ の範囲で5[°] おきに回転させ、約1m離れた場所での音圧、および距離を B & K 社製 4138 型マイクロホンで測定した.すべてのデータは 200 回の測定における平均値である.

図5 火花放電を用いた発信器の指向特性

後の応用が期待される.また本発信器のギャップ長は 0.35 mm と微小であり、シリコンプロセス等を用いたセンサのマイクロ化とは少々意見合いが異なるが、実用的な 音圧が得られる空中用超音波発信器の究極の小形化である と言える.

本来なら受波器も無指向性点近似できるものが望ましい が、このような受波器で市販されているものは次章で述べ るように数少なく高価である。そこで本システムでは受波 器として直径 26 mm の通常の送受兼用コンデンサマイク ロホンを用いた。受波器の指向性が半減角 6°と鋭いため、 受波器をサーボモータにより水平、鉛直方向に回転可能に し、発信器に対し受波面が常に正面を向くようにしている。

2.4 ロボットアーム先端位置の計測例

6自由度多関節型ロボット(PUMA 560)に直線軌道を 描かせ、その動的位置を本システムで計測した例を図6に 示す.またペン書きにより得られた軌跡も図中にあわせて 示す.これより(1)ペン書き結果と計測結果は高い精度で 一致しており、本システムは従来 ロボットの軌跡の測定手段として 一般的に用いられているペン書き 方式の代替手段として有望であ る、(2)ロボットが重力の影響を 受けて Z 方向にびびり振動を行 う様子、機構の寸法誤差に起因し て軌道の中央付近で Z 座標が1 mm 近く目標軌道から逸脱する 様子を本システムは正確に検出し ている等のことが判明した.

 ロボット用超音波セン サの小形・マイクロ化の展望

3.1 小形化による無指向性センサの可能性

将来的にマイクロロボットへの応用や,コウモリ等生物 の超音波送受機能を模擬することを考えた場合,超音波セ ンサをさらに小形化することは重要であると思われる.こ こでは指向性の観点から超音波センサの小形化の意義を考 えてみる.発信器の近似モデルとして半径 αの円形ピス トン音源を考え,波長をλとすると,指向の半減角 θ_{1/2} は 次式で与えられる.

$$\theta_{1/2} = \sin^{-1} \frac{0.353\lambda}{a} \tag{2}$$

すなわち同じ波長 λ の音波を発生する音源においては半 径 a が小さいほど半減角は大きくなり,指向性が広がる. これは受波器にも当てはまる.図1で分類した B, D タイ プの研究では無指向性の発信器,受波器が必要とされ,発 信器は前章で述べた火花放電を用いたものが将来的に援用 できるとして,受波器に関しては半径の小さい無指向性受 波器が望まれる.この観点から受波器の小形化は重要であ る.





実際は保護グリッド(図は省略)を付けて使用する



現在市販されている無指向性近似できる受波器として, B&K社製の4138型コンデンサマイクロホンがあり,図 7にその構造を示す⁹. 膜とバックプレートの間には200 Vのバイアス電圧が加えられており,膜の振動による容 量変化により音波を検出する. 周波数特性は0~100 kHz 程度まで平坦であり,感度も1.3 mV/Paと実用的である ため超音波領域まで使用できる音圧校正用の標準マイクロ ホンとして広く使用されている. またデータシートによる と 60 kHz の超音波に対してほぼ無指向性が実現されてい る. しかしながら本受波器は構造が精巧・複雑なため,高 価であるという欠点がある. このような状況を考慮する と,今後シリコンプロセス等により小形,無指向で低コス トな超音波受波器が開発されることが望まれる.

3.2 超音波センサのマイクロ化に関する最近の研究

超音波センサに関してもシリコンプロセスを用いて製作 されたものが報告されており、それらは主にコンデンサ 型¹⁰⁾, 圧電型¹¹⁾, 熱膨張型¹²⁾に分類される. 図8にコンデ ンサ型センサの報告例を示す. 異方性エッチングにより膜 厚1.5 µm のシリコンの薄膜を作り、ガラス製のボールを 介してアルミニウムが蒸着されたガラス製のバックプレー トを取り付けている.2mm角のセンサを作製して無指向 性の受波特性を実現しているが、感度が先に述べた B & K 社の 4138 に比べてかなり低い.他の圧電型,熱膨張型 のセンサの報告例でも同様に発信音圧, 受信感度が低く, 現状では 10 mm 程度の近距離測定の用途にしか用いるこ とはできないようである. 音圧, 感度を高めるためには, 空気の音響インピーダンス(媒質の密度と音速の積)が固 体に比べて小さいので、膜の振動振幅を大きくしなければ いけない、このためには強度を保ちつつ膜をできるだけ薄 くする必要があり、今後の製作プロセスの発展が望まれる. シリコンプロセスによる超音波センサは膜と外枠を同一 のシリコンで作製でき膜を機械的に固定する必要がないた め、構造の簡略化、低コスト化、性能の均一化が期待でき る. また同一基板上に多数のセンサを作ることができるの でアレイ型センサが製作しやすい. 音圧等の発信機能に関 しては筆者が開発した火花放電を用いたものが優れている

ことを考慮すると、シリコンプロセスによるセ ンサはこのような特長を生かして図1で分類し た B,D タイプのシステムにおける受波器の用 途に最も適しており、将来的にこの用途への応 用が広がることが期待される.

4. ま と め

超音波センサを用いたロボット用計測システムを4つのタイプに分類し、このうち外部から ロボット自体の絶対的な位置を計測するタイプ の例として、筆者が開発した電気火花放電を発

信器として用いる計測システムを紹介した.また超音波セ ンサを小形化する意義について検討し,最近のシリコンプ ロセスによる研究についても簡単に紹介した.マイクロマ シンの研究が進み機構が小さくなるとその振動は超音波領 域になることが多く,それを検出する意味からも超音波セ ンサの今後一層の小形・マイクロ化が望まれる.

謝 辞

第3章を書くにあたり参考文献を送付して頂き,ご討論 頂いたオリンパス光学工業(株)の宮島博志氏に深く謝意を 表します.また超音波センサの研究に関して日ごろよりご 指導を賜っております金沢大学教授・岡部佐規一先生,同 教授・神谷好承先生,東京大学教授・高野政晴先生,同助 教授・佐々木健先生に深く謝意を表します.

参考文献

- 例えば、中嶋新一,高橋禎一:分布型受波器をもつ姿勢計測 用超音波センサ、日本ロボット学会誌,6,1 (1988) 52.
 例えば、N. Takanashi, K. Higuchi, T. Horiguchi, H. Fuku-
- 2) 例えば, N. Takanashi, K. Higuchi, T. Horiguchi, H. Fukuchi and H. Tanigawa: A Robotic Ultrasonic Imaging System Using a Si Phased-array Receiver, Proc. 20th Int. Symp. Industrial Robots, (1990) 173.
- 3) 佐々木 健,小野勝久,高野政晴:ロボットのための高精度 超音波センサの開発研究,精密機械,51,6 (1985) 1238.
- 4) 例えば, S. Kuroda, A. Jitsumori and T. Inari: Ultrasonic Imaging System for Robot Using Electronic Scanning Method, Proc. 1983 Int. Conf. Advanced Robotics, (1983) 187.
- 5) Y. Kanayama, S. Yuta and Y. Kubotera : A Sonic Finding Module for Mobile Robots, Proc. 14th Int. Symp. Industrial Robots, (1984) 653.
- 6)馬 樹元,下河辺 明:超音波による3次元座標測定,精密 工学会誌,54,12 (1988) 2359.
- 8) GP-8-3D Sonic Digitizer Operator's Manual, Science Accessories Corp., (1985) 1.
- 9) Condenser Microphones Data Handbook, Brüel & Kjær, Nærum, Denmark, (1982) 1.
- K. Inoue, Y. Suzuki and S. Ogawa : Fabrication of Ultrasonic Sensor Using Silicon Membrane, Proc. 8th Int. Conf. Solid-State Sensors and Actuators, (1995) 616.
- 11) A. Lal and R. White: Micro-Fabricated Acoustic and Ultrasonic Source/Receiver, Proc. 7th Int. Conf. Solid-State Sensors and Actuators, (1994) 712.
- 12) M. Hornung, O. Brand and H. Baltes: Optimization of Micromachined Ultrasound Transducer by Finite Element Simulation, Proc. 8th Int. Conf. Solid-State Sensors and Actuators, (1995) 620.